

國立高雄師範大學職業衛生風險評估表

系所：光電與通訊工程學系

實驗室名稱：雷射與光纖元件實驗室

填報日期：2013.12.25

(一)實驗室作業流程概要內容：

- (1) 使用光學軟體或自寫程式模擬雷射系統。
- (2) 以半導體雷射幫浦晶體或光纖、建立雷射系統產生雷射光源。
- (2) 雷射光源特性量測

(二)實驗設備、儀器及材料：

(1)測量儀器：

Power detector (PD, 光偵測器)
Optical spectrum analyzer (OSA, 頻譜分析儀)
M-square analyzer (光束模態分析儀)
Polarization analyzer (偏振分析儀)

(2)雷射：

35 W 808 nm laser diode
10 W 915 nm laser diode
10 W 975 nm laser diode
He – Ne laser

(3)光學元件：

晶體、光纖、平凹面鏡、透鏡、濾波片....等

(4) 其他:

模擬軟體、機械類、電子類與電腦類耗材。

(三)實驗程序：

以 He – Ne laser 校正雷射系統內之光學元件 → 產生雷射光源 → 雷射光源特性量測與分析。

危害鑑別與風險評估表

附表	(附表一)										(附表二)				(附表三)
	(第1項)	(第2項)	(第3項)			(第4項)	(第5項)	(第6項)		風險評估				風險等級	
項次	區域/設備/作業	作業步驟	狀況			安全衛生危害因子說明	災害類型	現有風險控制方法		嚴重度 S	危害發生 機率 P	風險控制 成效 C	風險 R=S×P×C		
			例行	非 例行	緊急			軟體	硬體						
1.	雷射光學桌	調整雷射時眼睛的水平面高於雷射光路	◎			眼睛直視雷射導致眼睛受傷	人為不當操作	1. 加強宣導 2. 注意光路	1. 配戴護目鏡 2. IR 卡	1	1	0.4	0.4	E	
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															

填表人員：劉修安

實驗場所負責人：易瑞昀 老師

系所主管：